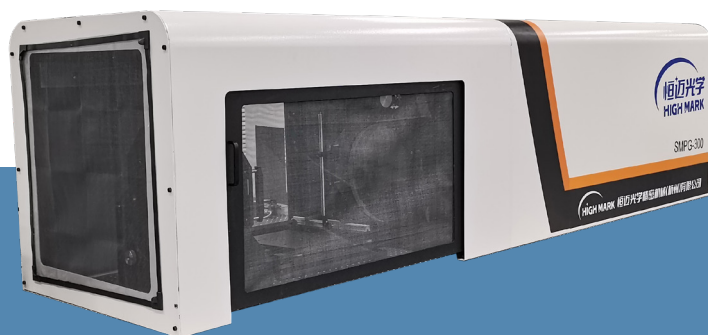




精密光学检测仪器

大口径激光干涉仪

激光干涉仪采用相移技术准确表征被测表面的三维形貌，测量精度 P_v 高达 $0.06\mu m$ 甚至更高，广泛用于平面光学元件高精度检测。



优势

1. 准确测量大口径的光学元件的透射波前、反射波前。
2. 测量精度和测量重复性能媲美美国 Zygo 和 4D 干涉仪。
3. 根据客户要求定制开发。

主要技术指标

技术参数产品系列	Φ300 移相数字化干涉仪	Φ600 移相数字化干涉仪	Φ800 移相数字化干涉仪
测量方式	菲索干涉原理	菲索干涉原理	菲索干涉原理
测量口径	300mm	600mm	800mm
移相方式	波长移相	偏振移相或波长移相	偏振移相或波长移相
主机波长	632.8nm	660nm 或 632.8nm	660nm 或 632.8nm
透射平面参考镜面形误差 (PV)	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$
反射平面参考镜面形误差 (PV)	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$
空腔精度 (PV)	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$	$\leq \lambda/10, \lambda=632.8nm$
面形误差测量重复性	$\leq 1nm (2\sigma)$	$\leq 1nm (2\sigma)$	$\leq 1nm (2\sigma)$
主相机分辨率	2048*2048	2048*2048	2048*2048
主相机调焦能力	有	有	有
测量高平行度光学元件透、反射波前	支持	支持	支持
工作温度要求	$22^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$	$22^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$	$22^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$
工作温度波动要求	每小时变化小于 $1^{\circ}C$	每小时变化小于 $1^{\circ}C$	每小时变化小于 $1^{\circ}C$
工作湿度要求	$55\% \pm 10\%RH$	$55\% \pm 10\%RH$	$55\% \pm 10\%RH$
隔震要求	气浮平台，固有频率：1-2Hz	气浮平台，固有频率：1-2Hz	气浮平台，固有频率：1-2Hz
工作电压	220V	220V	220V

